

仕 様 書

1. 件名

FIB-SEM デュアルビーム装置 (XVision 200DB) 部品

2. 研究の概要

国立研究開発法人産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門では、熱磁気効果を利用した材料開発とその評価、デバイス開発を進めている。薄膜等のナノスケールサイズを持つ微小な試料において、微細加工を用いた形状や構造の評価及び局所的金属デポジションによる熱磁気効果測定用試料の作製を行う。これら作業に際し、ナノスケール加工・金属デポジション機能を有する FIB-SEM デュアルビーム装置 (XVision200DB) を使用して実施する。

3. 物品の概要

本物品は、FIB-SEM デュアルビーム装置 (XVision200DB) の SEB 部に必要な消耗品である。

4. 部品名および数量

(1) Schottky field emitter DEN	1 個
(2) EXTRACTOR APERTURE 400 μ	1 個
(3) FRONT APERTURE 40 MY PLATI	1 個
(4) 薄型 6 hole AP	1 個
(5) Cooper Sealer DN 100 for C	1 個
(6) Al シール	1 個

5. 納入物品

(1) FIB-SEM デュアルビーム装置 (XVision 200DB) 部品 一式

6. 納入の完了

本装置は、「5. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入され、仕様書を満たしていることを確認して、納入の完了とする。

7. 納入期限及び納入場所

納入期限：2024年8月30日

納入場所：茨城県つくば市梅園1-1-1

国立研究開発法人産業技術総合研究所 省エネルギー研究部門
つくばセンター中央事業所2群 2-1A棟234室

8. 付帯事項

本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議すること。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者と協議のうえ決定する。